

走査電子顕微鏡 (日立 S5200)

【装置概要】

- ・電界放出型走査電子顕微鏡 (FE-SEM)
- ・各種材料の表面状態，透過像を高倍率で観察する装置

【日時】

令和2年1月23日（木） 9:30 ~ 12:00

【場所】

岡山大学新技術センター107号室

【概要】

- ・測定装置の概要等の説明（107号室）
- ・装置操作法の実地講習（107号室）

【講師】

岡山大学異分野融合先端研究コア 大久保 智子（監守者）

【申込み方法】

自己測定ご希望の方は必ず受講してください。

実地講習受講人数：10人

（各研究室2人以内，初めて受講する方を優先します。）

1月8日（水）までに下記宛お申込みください。

岡山大学異分野融合先端研究コア 仁科研究室（内線8711）
e-mail: t_ohkubo@okayama-u.ac.jp（本件担当：大久保）